

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im AB1.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 5. November 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1027/14 - 3.4.02

Anmeldenummer: 10790722.2

Veröffentlichungsnummer: 2603790

IPC: G01N29/04, G01N29/265,
G01N29/27, G01N29/275,
G01B7/06, G01B15/02, G01B17/02,
G01B21/08, G01N21/95,
H01L21/00, H01L21/66

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
MESSEINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR MESSUNG VON SCHICHTDICKEN
UND FEHLSTELLEN EINES WAFERSTAPELS

Anmelder:
Ev Group E. Thallner GmbH

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPÜ Art. 54(1), 54(2), 111(1)

Schlagwort:
Neuheit - Hauptantrag (ja) - nach Änderung
Zurückverweisung an die erste Instanz - (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1027/14 - 3.4.02

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02
vom 5. November 2014**

Beschwerdeführer: Ev Group E. Thallner GmbH
(Anmelder) Dl Erich Thallner Straße 1
4782 St. Florian am Inn (AT)

Vertreter: Schweiger, Johannes
Patentanwälte
Becker & Müller
Turmstraße 22
40878 Ratingen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 16. Dezember 2013 zur Post gegeben wurde und mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 10790722.2 aufgrund des Artikels 97 (2) EPÜ zurückgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender A.G. Klein
Mitglieder: A. Hornung
B. Müller

Sachverhalt und Anträge

I. Die Anmelderin hat gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 10790722.2 Beschwerde eingelegt. Die Prüfungsabteilung war zur Auffassung gekommen, dass die Anmeldung gemäß Hauptantrag den Erfordernissen der Artikel 54(1) und (2) EPÜ nicht genüge. Die beiden Hilfsanträge 1 und 2 wurden gemäß Regel 137(3) EPÜ nicht zum Verfahren zugelassen.

II. Die Anmelderin beantragt, ein Patent auf der Grundlage der mit der Beschwerdeschrift vom 28. Januar 2014 eingereichten Patentansprüche 1 bis 3 zu erteilen.

III. Die angefochtene Entscheidung verweist auf die folgenden Druckschriften:

D1: US 6,774,989 B1

D2: CA 2 314 305 A1

IV. Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Messung und/oder Erfassung von Schichtdicken und Fehlstellen einer oder mehrerer Schichten eines temporär gebondeten Waferstapels an einer Vielzahl von am Waferstapel verteilten Messstellen bevor der Waferstapel geschliffen wird, mit folgendem Ablauf:

- Anordnung einer Messeinrichtung zur Messung und/oder Erfassung der Schichtdicken und Fehlstellen der Schichten des Waferstapels an den Messstellen gegenüber einer Flachseite des Waferstapels,

- Aussendung von Signalen in Form elektromagnetischer Wellen oder Ultraschallwellen durch einen Sender der Messeinrichtung und Empfang der von dem Waferstapel reflektierten Signale durch einen Empfänger der Messeinrichtung,

- Auswertung der vom Empfänger empfangenen Signale durch eine Auswerteeinheit, wobei von mindestens zwei Übergängen zwischen Schichten des Waferstapels reflektierte Signale von der Auswerteeinheit unterschieden und deren Abschnitt zu einer Referenzebene (R) ermittelt werden, und wobei die Bewegung des Waferstapels und/oder der Messeinrichtung parallel zur Referenzebene (R) und damit die Position jeder Messstelle entlang der Referenzebene (R) erfassbar ist."

Entscheidungsgründe

1. Neuheit

Der vorliegende Verfahrensanspruch 1 stellt eine eingeschränkte Fassung des unabhängigen Verfahrensanspruchs 11 des von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Hauptantrags dar.

In Bemerkungen, die zwar in die angefochtene Entscheidung aufgenommen wurden, jedoch ausdrücklich als "Einwände, die nicht Grundlage der Entscheidung sind", bezeichnet wurden, erhob die Prüfungsabteilung den Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit bezüglich des in Anspruch 11 definierten Verfahrens. Dabei gab die Prüfungsabteilung zu erkennen, dass das beanspruchte Verfahren neu sei, weil es aus keinem der vorliegenden Druckschriften bekannt sei. Insbesondere stellte die Prüfungsabteilung fest, dass eine relativ zum Waferstapel bewegliche Sender-Empfänger-Einheit, wie beansprucht, nicht aus D1 und ein Waferstapel, wie beansprucht, nicht aus D2 bekannt sei.

Die Kammer teilt die Ansicht der Prüfungsabteilung, wonach das Verfahren des damaligen Anspruchs 11 im Hinblick auf den vorliegenden Stand der Technik neu ist.

Mit der Beschwerdeschrift reichte die Anmelderin einen geänderten Verfahrensanspruch 1 ein, der, bezogen auf den damaligen Anspruch 11, weiter eingeschränkt wurde, und zwar durch das Hinzufügen der Merkmale "temporär gebondeten Waferstapel" und "bevor der Waferstapel geschliffen wird".

Die Kammer sieht daher keinen Anlass, die Neuheit des beanspruchten Verfahrens in Frage zu stellen.

2. Da der Zurückweisungsgrund der fehlenden Neuheit durch das Einreichen eines neuen Anspruchssatzes, bestehend aus dem geänderten Verfahrensanspruchs 1 und den beiden hiervon abhängigen Ansprüchen 2 und 3, ausgeräumt wurde, kann die angefochtene Entscheidung keinen Bestand haben.

3. Zurückverweisung an die erste Instanz

3.1 Die Kammer stellt diesbezüglich folgende Punkte fest:

- Der einzige Zurückweisungsgrund in der angefochtenen Entscheidung, d.h. fehlende Neuheit, wurde - wie soeben dargelegt - durch das Einreichen eines geänderten Verfahrensanspruchs 1 ausgeräumt.
- Der Einwand der Prüfungsabteilung der fehlenden erfinderischen Tätigkeit betreffend das Verfahren des damaligen Anspruchs 11 wurde - wie bereits ausgeführt - von der Prüfungsabteilung ausdrücklich nicht zur Entscheidungsgrundlage gemacht. Der Anmelder hat zu diesem Einwand laut Akteninhalt auch nicht Stellung genommen.

- Der vorliegende Anspruch 1 enthält wesentliche Änderungen im Vergleich zu dem damaligen Anspruch 11. Aus der Beschreibung der Anmeldung geht hervor, dass die beiden zusätzlichen Merkmale des Anspruchs 1 auf eine spezifische Ausführungsform des Messverfahrens abzielen, bei der eine Kleberschicht und ein Schleifprozess wesentliche Aspekte der Erfindung darstellen (siehe Seiten 2 bis 8 der ursprünglichen Beschreibung).

3.2 Da der vorliegende Sachverhalt sich im Vergleich zu demjenigen, auf Grundlage dessen die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung traf, grundsätzlich verändert hat, übt die Kammer das ihr von Artikel 111 (1) EPÜ eingeräumte Ermessen dahingehend aus, dass sie die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverweist.

3.3 Um Zweifel zu vermeiden, möchte die Kammer betonen, dass sie mit der vorliegenden Entscheidung lediglich die Neuheit des beanspruchten Messverfahrens im Lichte des vorliegenden Stands der Technik bejaht hat.

4. Die in der Beschwerdeschrift hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung brauchte nicht durchgeführt zu werden. Denn die Bedingung für den Antrag auf mündliche Verhandlung ist angesichts des Erfolges der Beschwerde nicht eingetreten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



M. Kiehl

A.G. Klein

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt